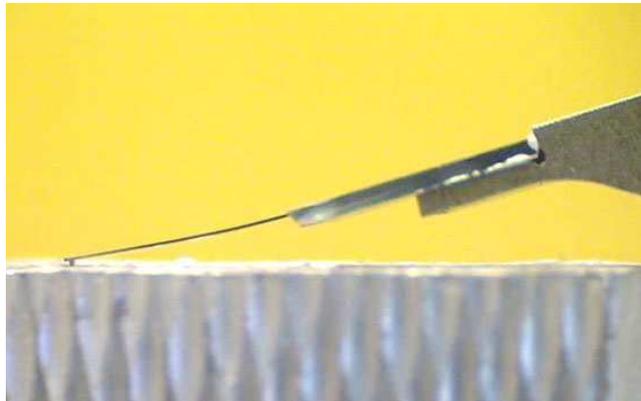


# Workshop "Fertigungsmesstechnik funktional - taktil - optisch"

Optische und taktile Messtechniken analysieren kleinste Fertigungstoleranzen bei Oberflächen, Bohrungen oder Rauigkeiten in der Produktion. Schnelle Messdatenerfassung und -verarbeitung sind dabei heute unabdingbar um eine gleichbleibende Qualität zu garantieren. Zunehmend werden optische und taktile Methoden als Multisensorsystem kombiniert um die Vorteile beider Verfahren zu vereinen. Der Workshop schlägt eine Brücke von der Forschung bis zur Anwendung, von der Komponente bis zum fertigen System für taktile und optische Messsysteme.

Die CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH als wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung und der CiS e.V. sowie die Kooperationspartner GFE Schmalkalden e.V. und MNT e.V. laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein.



## Programm:

09:00 Uhr - **Begrüßung**

Prof. Thomas Ortlepp, stellv. Institutsleiter,  
CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

09:10 Uhr

**Taktile und optische Rauheitsmesstechnik – Stand der aktuellen Normung und Eigenschaften der Messeinrichtungen**

Prof. Jörg Seewig, Lehrstuhlinhaber für Messtechnik und Sensorik, Technische Universität Kaiserslautern

10:00 Uhr

**Modulare Mikrotaster-Systeme**

Stefan Völlmeke, Projektleiter, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt

10:25 Uhr

**Anwendbarkeit von piezo-resistiven Cantilevern zur Oberflächendiagnostik - Möglichkeiten, Schwierigkeiten, Grenzen**

Manuel Fiedler, Projektingenieur, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt

10:50 Uhr

**Applikation von Mikrotastern für die Inline-Messung drehgefräster Oberflächen**

Dr. Steffen Reich, Geschäftsbereichsleiter IWQ, Werkzeugtechnik/Technologie, GFE - Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e.V.

11:15 Uhr - **Pause**

11:25 Uhr

**Taktile und optisch messende Verfahren in der Produktion von optischen Komponenten**

Dr. Andreas Beutler, R&D Advanced Technologies, Mahr GmbH, Göttingen

11:50 Uhr

**Taktile Oberflächenmesstechnik mit Si-Mikrotastern**

Dr. Uwe Brand, Leitung AG Härte und taktile Antastverfahren, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

12:15 Uhr - **Pause**

13:15 Uhr

**Industrielle Anforderungen an die Fertigungsmesstechnik - Multisensor-Koordinatenmesstechnik für Mikrostrukturen**  
Matthias Andräs, Leiter DAkKS Labor / Manager DAkKS-Laboratory, Werth Messtechnik GmbH

13:40 Uhr

**Miniaturisierter optischer Rauheitssensor zur Oberflächencharakterisierung**  
Stefan Görlandt, Projektleiter, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt

14:05 Uhr

**Von der off-line zur in-line 3D- und Oberflächenmessung**  
Prof. Gunther Notni, Stiftungsprofessor Industrielle Bildverarbeitung TU Ilmenau, Abteilungsleiter Optische Systeme, Fraunhofer IOF, Jena

14:30 Uhr

**Abschlussdiskussion/ Besichtigung**

Änderungen vorbehalten!

Aktuelle Informationen zum Programm finden Sie unter [www.cismst.de/fertigungsmesstechnik](http://www.cismst.de/fertigungsmesstechnik)

## Organisatorisches:

### Termin:

22.04.2015, 09:00 Uhr

### Ort:

Anwendungszentrum Mikrosystemtechnik  
Konferenzraum 3. OG  
Konrad-Zuse-Str. 14  
99099 Erfurt

### Info:

Dipl.-Krist. Uta Neuhaus  
Tel. 0361 663 1160  
[uneuhaus@cismst.de](mailto:uneuhaus@cismst.de)

## Anmeldung

an Fax 0361 663 1413

Bitte bis **spätestens 17.04.2015** an  
CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 14  
99099 Erfurt

Hiermit melde ich mich **verbindlich** für die  
Teilnahme an dem Workshop Fertigungsmesstechnik  
am 22.04.2015 in Erfurt an.

Name,  
Vorname: .....

Titel: .....

Firma/Einrichtung: .....

.....

.....

### Teilnahmegebühr:

100 € inkl. 19 % MwSt. per Überweisung an

CiS Forschungsinstitut  
IBAN: DE49 8204 0000 0107 4210 00  
BIC: COBADEFFXXX  
Commerzbank AG  
Zweck: WK Fertigungsmesstechnik

Im Leistungsumfang sind Tagungsunterlagen und  
Pausenversorgung enthalten.

Unterschrift/Datum:



### Veranstaltungsort:

Anwendungszentrum Mikrosystemtechnik  
Konferenzraum 3. OG  
Konrad-Zuse-Straße 14  
99099 Erfurt

### Veranstalter:

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

### Anfahrtskizze:

[www.cismst.de/kontakt/anfahrt/](http://www.cismst.de/kontakt/anfahrt/)



Forschungsinstitut  
für Mikrosensorik GmbH



GFE - Gesellschaft für  
Fertigungstechnik und  
Entwicklung Schmalbanden  
e.V.

## Einladung zum Workshop

**Fertigungsmesstechnik**  
**funktional - taktil - optisch**

am

**22.04.2015**

im

**Anwendungszentrum  
Mikrosystemtechnik  
Erfurt**

Kooperationspartner:



**MNT**  
Mikro-Nano-Thüringen